

卓上マッフル炉

1. 概要

KDF S80 は、試料の焼成、熱処理、乾燥、アニール等を目的とした卓上型の電気マッフル炉である。本装置はコンパクトな卓上サイズでありながら、最高使用温度 1050 °C に対応し、研究用途における各種材料の高温処理を安全かつ安定して実施できる設計となっている。炉内有効寸法は 170(W)×150(H)×260(D) mm、炉内容積は 6.6 L であり、小型試料から中型試料までの熱処理に対応する。



2. 特性

・基本仕様

最高使用温度：1050 °C

昇温性能：1000 °Cまで約 12 分

プログラム運転：9 エリアのプログラム、最大 4 エリアまでリンク可能

安全機能：過電流ブレーカ、炉内温度感応型冷却ファン、過昇温設定器

3. 設置場所

第一研究棟 I-116

4. 提出書類

装置担当者にお問い合わせください

5. 装置担当者、連絡先

南部雄亮 (Phone: 072-451-2645, Email: nambu.yusuke.7s_at_kyoto-u.ac.jp)